

【コンポーネントの特徴】

ICF フランジにマウントされた真空中の部品(基板ホルダー、加熱機構、熱電対等)を溶接ベローズの伸縮を利用して、任意の位置まで直線的かつ正確に移動を可能にした機構です。

固定フランジと移動フランジ共にICFフランジ仕様となっているので、各種超高真空装置に使用可能です。

【共通仕様】

固定・移動フランジ……ICF70・キリ穴

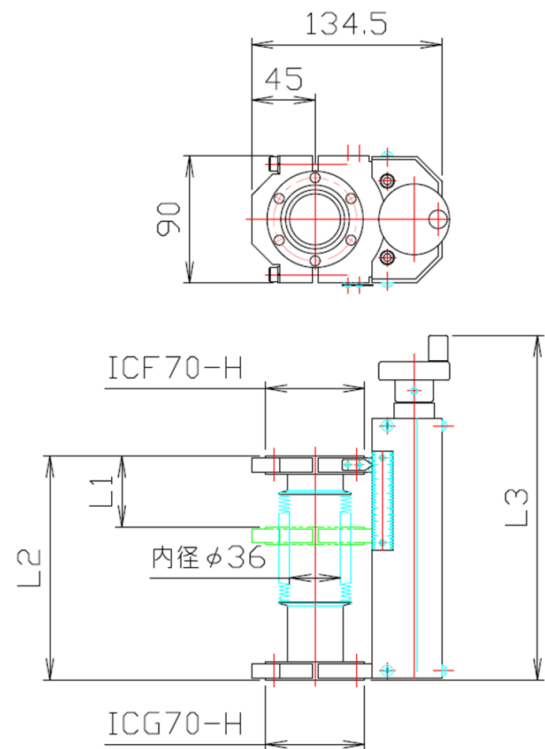
有効内径 …… $\phi 36\text{mm}$

材質 ……SUS304(溶接ベローズ:SUS316L)

最高使用温度…… 200°C

リーク量 …… $1.3 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下

側面に位置決めスケール板付き



【ラインナップ仕様】

型式	ZLT70-50	ZLT70-80	ZLT70-100
L1 寸法	ストローク:50	ストローク:80	ストローク:100
L2 寸法	158	200	232
L3 寸法	245	285	320

※有効径 $\phi 50\text{mm}$ の製品も制作可能です。

(株)真空デバイス/城里工場

☎311-4305 茨城県東茨城郡城里町上青山298-1

☎ 029-240-6005(FAX6008)

HP <http://www.shinkuu.co.jp>